

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成20年9月11日(2008.9.11)

【公表番号】特表2006-514149(P2006-514149A)

【公表日】平成18年4月27日(2006.4.27)

【年通号数】公開・登録公報2006-017

【出願番号】特願2004-572150(P2004-572150)

【国際特許分類】

C 0 8 J 7/00 (2006.01)

【F I】

C 0 8 J 7/00 3 0 2

C 0 8 J 7/00 C E R

C 0 8 J 7/00 C E Z

【誤訳訂正書】

【提出日】平成20年7月24日(2008.7.24)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】請求項 1

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項 1】

それを通して電磁波を遮蔽するためのポリマー成型品の表面をイオン化する方法で、次のようなステップから構成される：

第一ステップ：真空ユニットを構成する主チャンバーと主チャンバーの前と後に置かれたプレチャンバーを真空ポンプを使って、 10^{-5} torrの減圧条件に維持する。

第二ステップ：イオン照射される対象体を入口チャンバーのキャリアー上にあるパネホルダーによって保持し、パネホルダーに保持された対象製品を予熱チャンバーとプレチャンバーを通して主チャンバーへと移す。

第三ステップ：フィラメントの加熱によって、あるいはイオンガス銃のアーク発生によってプラズマを発生させる。ここでは、ガス陽イオンを発生させるためにプラズマにヘリウムガスやアルゴンガスや窒素ガスを加えて、主チャンバーのイオン発生銃に供給される電源ビームカレントを予め決められたレベルに制御し、対象製品にガス陽イオンを照射する。

第四ステップ：得られたイオン化製品を主チャンバーから第二のプレチャンバーへキャリアーを使って移動させる。その次に、得られたイオン化製品を出口チャンバーを通して排出させる。

【誤訳訂正 2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 1 6

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 1 6】

上述の及び / あるいはその他の目的は、それを通して電磁波を遮るためのポリマー成型品の表面をイオン化する方法を提供することで、次のようなステップが含まれる。即ち、第一ステップは、主チャンバーと主チャンバーの前と後に置かれた第一と第二のプレチャンバーを保持することである。これは真空ポンプを使って 10^{-5} torrに減圧する真空ユニットが構成要素となっている。第二のステップは、入り口チャンバーのキャリアー上に位置しているパネホルダーによって、イオンを照射するために対象製品を保持すること、

及びバネホルダーに保持された対象製品を予熱チャンバーと第一プレチャンバーを通して主チャンバーへ移動させることである。第三のステップは、フィラメントの加熱によって、あるいは又主チャンバーにおいて、ヘリウムガスあるいは窒素ガスあるいはアルゴンガスをガス陽イオン発生のためのプラズマに加えて、イオン発生銃に供給される電圧のイオンビームカレントを予め決めたレベルに制御したイオン化銃のアーク発生によってプラズマを発生させること、及び対象製品にガス陽イオンを照射することである。第四のステップは、イオン化された製品をキャリアーを使って主チャンバーから第二のプレチャンバーへ移動させ、次に出口チャンバーを通してイオン化製品を排出させることである。

【誤訳訂正３】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】００３２

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【００３２】

第四ステップで、主チャンバーでイオン化されたポリマー成型品は次に、キャリアーによってプレチャンバーへ移される。そして出口チャンバーを通して排出され、従ってポリマー成型品の表面イオン化が達成される。